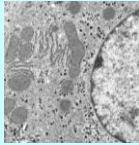

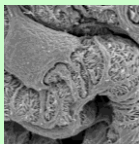
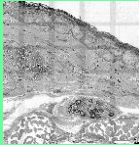
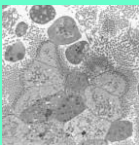
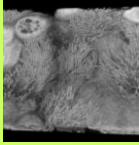
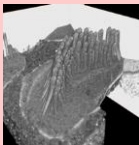


電子顕微鏡室 利用負担金 <学内>

内容		単位	単価
登録料	登録料は研究室（ラボ）単位での支払いになります	1年	¥80,000

工程内容				単位	単価		
TEM (透過型電子顕微鏡)	通常サンプル 	サンプル作製料	オスミウム固定→脱水→エポキシ樹脂包埋 (自動包埋機使用もしくは手作業)→熱重合	1回	¥5,500		
			準超薄切片作製	1断面	¥600		
			超薄切片作製 (通常：150グリッド2枚の場合)	1断面	¥1,200		
			超薄切片作製 (特注：単孔グリッド1枚の場合)	1断面	¥1,500		
			超薄切片作製単孔グリッドの追加 (特注：2枚目以降)	グリッド1枚	¥280		
	特殊サンプル (ネガティブ染色) 	by user	親水化処理→ウラン染色	1回 (グリッド10枚まで)	¥800		
		代行	親水化処理→ウラン染色	グリッド1枚	¥1,400		
	観察料			透過型電子顕微鏡 (午前：9時半～12時半、午後：1時半～4時半)	1回 (3時間)	¥2,500	
	SEM (走査型電子顕微鏡)	通常サンプル 	サンプル作製料	オスミウム固定→脱水→t-ブチルアルコール置換 →t-ブチルアルコール凍結乾燥 →台載せ→金属コーティング	1回	¥4,300	
				t-ブチルアルコール凍結乾燥→台載せ →金属コーティング	試料台1個	¥1,200	
金属コーティング (白金・カーボン・オスミウム)				試料台1個	¥510		
観察料				走査型電子顕微鏡 (午前：9時半～12時半、午後：1時半～4時半)	1回 (3時間)	¥2,500	
2D 電子顕微鏡解析		パノラマ観察法 *撮影代行 	サンプル作製	オスミウム固定→脱水→エポキシ樹脂包埋→熱重合	1回	¥5,500	
				準超薄切片作製	1断面	¥600	
				シリコン基板の利用	1/3枚	¥2,300	
				超薄切片作製	1断面	¥1,100	
				電子染色 (ウランおよび鉛染色)	1回	¥800	
		装置使用料			撮影条件の設定	1サンプル	¥1,100
					SEM撮影	1時間	¥830
		反射電子観察法 	サンプル作製	オスミウム固定→脱水→エポキシ樹脂包埋→熱重合	1回	¥5,500	
				準超薄切片作製	1断面	¥600	
				シリコン基板の利用	1/3枚	¥2,300	
超薄切片作製				1断面	¥1,100		
電子染色 (ウランおよび鉛染色)				1回	¥800		
観察料			走査型電子顕微鏡 (午前：9時半～12時半、午後：1時半～4時半)	1回 (3時間)	¥2,500		
3D 電子顕微鏡解析		アレイトモグラフィー法 *撮影代行 	サンプル作製	オスミウム固定→脱水→エポキシ樹脂包埋→熱重合	1回	¥5,500	
				準超薄切片作製	1断面	¥600	
				シリコン基板の利用	1枚	¥6,900	
				連続超薄切片作製 (超薄切片100枚毎)	1回	¥9,900	
				電子染色 (ウランおよび鉛染色)	1回	¥800	
				装置使用料			撮影条件の設定 (超薄切片100枚毎)
					SEM撮影	1時間	¥830
		FIB-SEM (集束イオンビーム 走査型電子顕微鏡) *撮影代行 	サンプル作製	オスミウム固定→Block Stain→脱水→エポキシ樹脂包埋 →熱重合	1回	¥5,700	
				FIB-SEM台載せまで (準超薄切片作製→ウルトラトリムを用いてのトリミング →stubへの台載せ→銀ペースト→白金コーティング)	試料台1個	¥6,700	
		装置使用料			serial section開始前の下準備 (DEPO・Polish・Milling)を含む	1時間	¥2,100
	画像解析		ソフト使用料	24時間単位で1回とする	1回	¥1,300	
			解析サポート	画像解析のサポート (内容に関しては要個別相談)	1時間	¥2,200	

利用料